## 日本国特許庁(JP)

4 特許出願公開

#### ⑫公開特許公報(A) 平3-102701

Solnt. Cl. 5 F 21 H 1/00 G 02 B 6/00 識別記号

庁內整理番号

@公開 平成3年(1991)4月30日

6/12

3 3 1

8112-3K 7132-2H 7036-2H

B

7036-2H 7036-2H 8943-5C

6/20 H 01 J 61/38

請求項の数 21 未請求 (全10頁)

**公**発明の名称 光学光源装置

> 创特 平2-239787 願

平2(1990)9月10日 忽出

優先権主張 Ø1989年9月8日每米国(US)愈404859

個発 ジョン ウエイ

アメリカ合衆国 マサチユーセツツ州 01945

マウス

ヘツド ベネツト ロード 16

创出 題 ジョン エフ ウエイ

アメリカ合衆国 マサチユーセツツ州 01945

マウス

ヘツド ペネツト ロード 16

升⑨ 弁理士 中村 外7名 稔

- 1. 発明の名称 光学光源装置
- 2.特許請求の範囲
- (1)、エネルギを電磁放射線に変換しかつ所定の値 より長い波長での放射を抑制するためのエネル 、ギ変換装置において、

スペルトルの光領域で前記電磁放射線を放射 させるための手段と、・

放射抑制手段とを備え、

前記放射手段は、ある物体のキャピティ列か ら成り、前記キャピティの寸法は、前記所定の 値より短い被長で放射された電磁線のみを前記 ・ 物体により伝婚することができるようになって いることを特徴とするエネルギ変換装置。

- (2) 前記所定の値は、前記抑制すべき長い波長が 不可視赤外電磁線となる値であることを特徴と する請求項(1) に記載のエネルギ変換装置。
- (3) 前記電磁線の放射手段は、前記赤外線抑制手 段のキャピティ内部で励起された原子から成る ことを特徴とする請求項(1) に記載のエネルギ 変換簽置。

- (4) 前記抑制手段は少なくとも一つの導波管であ り、前紀原子の励起は該導波管で生ずることを 特徴とする請求項(1) に記載のエネルギ変換装 11.
- (5) 前配抑制手段は導放管であり、該導放管は キャピティ列であり、該キャピティの各々は約 700mmのカットオフ波長と該カットオフ波 長よりかなり大きな深さとを有することを特徴 とする請求項(1) に記載のエネルギ変換装置。
- (6) 前紀キャビティの各々は幅350nmの正方 形断面であることを特徴とする請求項(5) に記 稜のエネルギ変換装置。
- (7)放電装置において、

透明閉じ込め手段と、

前紀閉じ込め手段内に設けられ互いに隔てら れている一対の電極と、

簡紀閉じ込め手段内に設けられたイオン化自 在の充塡ガスと、

顔記電極間に電位を与える手段とを鍛え、

前記電極の一方は赤外線放射抑制手段であ

り、簸却制手段は、ある物体のキャピティ列か

ら成り、該キャビティの寸法は、約700 nm より短い被長で放射された電磁線のみを前記物 体により伝播することができるようになってい ることを特徴とする放電装置。

- (8) 前記抑制手段は少なくとも一つの導波管であり、前記充填ガスのイオン化は該導波管で生ずることを特徴とする請求項(7) に記載の放電装置。
- (9) 前記抑制手段はキャビティ列であり、該キャビティの各々は約350nmの幅と該幅より大きな深さとを有することを特徴とする請求項(7) に記載の放電装置。
- (10)前記キャピティの各々は正方形断面であることを特徴とする請求項(9)に記載の放電装置。
- (11)前記抑制手段は穴を設けた金属層であり、前記層内の前記穴の各々は隣接する穴に対し規則的に配置され、該穴の各々は約350nmの橋と該幅よりかなり大きな深さとを有し、それによって約700nmより大きな波長での放射を抑制する導波管列を形成することを特徴とする請求項(7)に記載の放電装置。

幅と該幅よりかなり大きな深さとを有し、それによって約700mmより大きな波長での放射を抑制する導波管列を形成することを特徴とする請求項(12)に記載の白熱ランプ。

- (15)前記金属はタングステンであることを特徴と する請求項(12)に記載の白熱ランプ。
- (16)前記キャピティの各々は正方形断菌であることを特徴とする請求項(12)に記載の白熱ランプ。
- (17)加熱活性光源において、

加熱源手段と、

トリウム酸化物と分散させたセリウム酸化物の含浸剤とでできており、熱を受け取る関係で前記加熱源手段の近くに配置され、それによって、前記加熱源手段により加熱されたとき、光を放射するセラミック体と、

前記セラミック体に形成され、核セラミック体に配置されたキャピティ列から成り、前記キャピティの寸法は、約700ヵmより短い波長で放射された光のみを前記セラミック体により伝播することができるようになっている赤外

(12)約700nmより短い放長で電磁線を放射するようになっている放射光源を購えた白熱ランプにおいて、

金属体と、

スペクトルの可視領域で電磁線を放射するペ く前記金銭体に電位を与えるための手段と、

約700nmより長い液長での前記金属体からの電磁線放射を抑制するため、前記金属体表面と一体になっている手段と、

前記金属体と前記電位付与手段とを取り囲む ための透明閉じ込め手段と

から成ることを特徴とする白熱ランプ。

- (13)前記抑制手段はキャビティであり、該キャビティの各々は約350nmより小さな幅を有し、かつ約150nmより大きな距離で互いに隔でられ、更に700nmより長い電磁線の放射を抑制するのに十分深いことを特徴とする自然ランプ。
- (14) 前記抑制手段は穴を設けた金属層であり、 前記層内の前記穴の各々は隣接する穴に対し規 即的に配置され、鉄穴の各々は約350nmの

### 線抑制手段と

から成ることを特徴とする加熱活性光潭。

- (18)前記キャピティの各々は約350nmより小さな幅を有し、かつ約150nmより大きな距離で互いに関てられ、更に700nmより長い電磁線の放射を抑制するのに十分深いことを特徴とする請求項(17)に記載の加熱活性光源。
- (19)電磁線をほぼスペクトルの可視光線領域で放射するための装置において、

スペクトルの光領域にある波長の電磁線を放射する手段と、

前記電磁線放射手段と関連する少なくとも一つのキャピティ導波管手段とから成り、

解記導波管キャピティ手段は所定の横寸法を 有し、

前記導政管キャピティ手段及び前記所定寸法は、赤外線範囲の電磁線放射を制限することを特徴とする装置。

(20) 前記尋波賃キャビティ手段はキャピティ列であり、該キャピティの各々は約350nmの幅と、該幅より十分大きな深さとを有し、それに

よって、約700nmより長い波長での放射が抑制されることを特徴とする請求項(19)に記載の装置。

(21)前記キャピティの各々は正方形断面であることを特徴とする請求項(19)に記載の装置。

人工的な光源の高視感度を達成するために障害となるのは主として、エネルギを可視光線に変換する多くの装置が、波長の短い可視光線を犠牲にして相当多量に波長の長い赤外線 (該赤外線に対しては眼は感じない)を放出する結果となること

本発明は光学光源に関し、更に詳細には、電磁

放射器及びキャピティ導放管を備えた新しくかつ

3.発明の詳細な説明

(従来の技術)

である.

(産業上の利用分野)

改善された光源に関する.

光道の開発者に利用されている重要な手段は、 まず第1に、放射体の温度を上昇させることであり、第2に、赤外線領域での放射を制限する種類 の放射体を授すことであった。温度を上昇させる と、黒体放射曲線(上限をある波長の放射に設定 したもの)が波長の短い方にシフトして可視光線 を生ずる放射遷移を高めることができる。高温で 作動可能な耐熱性材料を捜すことが白熱電球の効 率を高める基礎となり、非常に低い爆光値から、

ガスマントル、炭素フィラメント白熱電球、そして現在のタングステンフィラメント電球へと改善された。それらの各々はより高温での作動を達成することができ、赤外線領域でのエネルギ部分をより小さくしつつ視感度を高くした。

赤外線でほとんど逐移しない放射体を励起することは、電気放電ランプ技術の基本であり、該ランプでは、励起された原子又は分子は赤外線をほとんど放射せず、黒体限界に達することなく、スペクトルの短波長領域で強い遷移がおこる。

タングステンフィラメント白熱電球が以前のものより明らかに利点があるにもかかわらず、これらの光源から放射される電磁線の90%又はそれ以上が限により感知されない赤外線領域である。今世紀の第2の段階でガス充塡タングステンフィラメント白熱電球が開発されたので、光源の高温作動を可能にする耐熱性材料はもはや発見されなかった。ガス放電光源における数多くの進歩にもかった。ガス放電光源における数多くの進歩にもかかわらず、最も効率のよい光源でも、限定された数の短波長遷移があるだけであり、従って、色彩現が制限され(低圧ナトリウムランプ)ある

いはかなり効率を落として紫外線を可視光線に変換するための螢光体を必要とした(螢光ランプ)。

原子又は分子の電子的に励起された状態の放射 寿命を宇宙の定数と考えるのが慣習である。しか しながら、これは、原子が自由空間にあってか つ、放射される電磁場の無限個の真空モードで無 限遠に放射することができるときにのみ、あては まる。

最近の研究は放射寿命が実際にはかなり変化することを示している。形状の変化における研究の中心となる結論は、いわゆる空洞量子電気力学理論 (Cavity Quantum Electrodynamic Principle)である。反射キャピティ又は導波管内の又はそれらに関連した励起状態は、キャピティ又は導波管の許容モードでのみ放射することができる。特に、もし選移波長がキャピティのカットオフ波長よりも大きければ、遷移確率はゼロである。

(PHYSICS TODAY, 1989 年1月, "Cavity Quantum Electrodynamics"24-30ページ参照)

従来技術では、タングスチンフィラメントラン

プからの放射はほんの5乃至10%の可視光線エネルギを含むだけであり、残りのほとんどは赤外線である。従来技術では、可視光線の放射割合を最大にするため、このようなフィラメントを、材料によって許容される最大温度で作動させることが知られており、該温度は、例えば、タングステン原子の表面からの気化によって制限される。その結果、効率とタングステンフィラメントランプの寿命との間で逆の関係が保たれることが知られている。効率が高くなればなるほど、寿命は短くなる。

従来技術では、いわゆる"マントル"を設けそれを火炎と接触させて約1500" Kの温度に加熱することにより、ガス火炎灯の視感度を増大させることが知られている。従来技術で知られているこのマントルは、セリウム酸化物をわずかに加えたトリウム酸化物から成るのが典型的である。ほとんど自由電子を持たずかつ5000nmより長い故長に設定された基本赤外線吸収/放射帯を有するため、マントルのセラミック体はかなり赤外線放射の少ない放射体となる。セリウムを混ぜ

分低い温度で作動しその結果券命が従来技術の自 熱電球を上回るとともに同時に効率が高くなる程 度に赤外線放射を低減することができる人工光源 を備えるエネルギ変換装置を提供することであ る。

本発明の望ましい目的は、赤外線放射を最小に する一方、可視光線放射を最大にする人工光波を 提供することである。

本発明の別の望ましい目的は、電磁放射光源部 材と少なくとも一つのキャピティ導波管部材とを 備えた新しくかつ改善された光源装置を提供する ことである。

これら及び本発明の他の望ましい目的はその一部が次に明らかとなり、又、一部が派付図面及び特許請求の範囲を参照して明和書の説明を考慮した後に明らかとなろう。

### (課題を解決するための手段)

本発明は、電磁線スペクトルの光領域において 新しくかつ改善された電磁線放射器を鍛える装置 を開示する。その装置は、可視及び不可視波を含 む波長範囲を有する電磁線放射光器と、該電磁線 ることは、スペクトルの可視領域での吸収/放射 張移を増加させて1500° Kでの光放射を高め る。その結果、このようないわゆる。ガスマント ル"は、1500° Kで約2ルーメン/ワットの 視感度を達成し、同じ温度でタングスチン放射体 が達成可能な0.2ルーメン/ワットよりもずっ と高い値となる。ガスマントルは、電気が利用で をない用途でガスを燃料とする携帯用ランプに幅 広く使用されている。

しかしながら、このようなマントルの構造においては、トリウム酸化物及びセリウム酸化物のセラミック体を処分することができると同時にこのようなマントルの効率を高めることが望まれるであろう。

### (発明が解決しようとしている課題)

従って、本発明の望ましい主要な目的は従来技 術の短所を克服することである。

本発明の望ましい別の目的は、エネルギの可視 光緯波長への変換を最大にするエネルギ変換装置 を提供することである。

本発明の更に別の望ましい目的は、放射面が十

放射光源と関連した少なくとも一つのキャビティ 導放管とを擴え、それによって、キャビティ導放 管は、長い被長すなわち横えば不可視赤外線範囲。 の電磁線放射の伝播を抑制するように構成されか つ配置されている。

本発明の性質と望まれる目的を完全に理解する ため、添付図面とともに次の詳細な説明を参照し なければならない。各図を通して同一の参照記号 は対応する部分を示している。

#### (実施例)

次に本発明を以下の実施例に関し説明する。 (実施例1-放電ランプ)

第1図乃至第3図を詳細に参照する。第2A図及び第2B図は本発明による高圧キセノン放電ランプの設計を示しており、該ランプには、細長い正方形の導放管キャビティ12内に配置した複数の別々のキセノン放電源10が備えられており、各キャピティは、各々(第2B図で最もよくわかるように)700nmの長さとをもつ構方向側面部材14A乃至Dによって形成されて

# 特開平3-102701 (5)

いる。各導波管キャピティ12はカットオフ波長を700nmとし、700nmより長い波長の光を放射させるモードは存在しない。従って、自由空間で700nmより長い波長の赤外線の放射の原因となるガス放電プラズマ(この実施例ではキセノン)の電子遷移が導波管キャピティ放電に発生するのを防止する。

従って第2図の放電ランプの放射スペクトルは、第3図に示すように、紫外及び可視領域では第1図に示す従来技術の放電ランプと同様であるが、導波管キャピティの放電限界が700ヵmであるため、かなり改善され、赤外波長範囲ではほぼせ口である。本発明によって赤外線放射を防止することにより、視感度が改善されることは容易に明らかとなろう。

第2図の放電ランプの細長い正方形の導波管キャピティ12は、従来の半導体リソグラフィー技術によって金属箔(例えば金や銀)に穴を形成するのが好ましく、該金属箔は、複数の導波管12及び中空陰極としての役目をする。各陰極に対する隔極構造は同様の技術によって形成され、

cm\*となる。各キャピティ放電のノーマルグロ・一最大電流は約79マイクロアンペアである。もし、キャピティ12の中心距離が1ミクロンであれば、キャピティは1cm\*につき10\*箇存在することになり、ノーマルグローモードの全電流は7900アンペア/cm\*となるであろう。

本発明の光波装置における電流の上限は、放電がパルスモードで作動しない限り、最大ノーマルグロー電流よりもずっと低い値で熱を消散できる構造能力によって設定されるであろうことを理解しなければならない。

第2図に示した高圧キセノン放電ランプの特定の実施例は単なる例示である。本発明の原理を具現化する他の設計を用いてもよい。例えば、他の気体を使用してもよい。又、もっと長いカットオフ波長に対応してもっと大きな閉口の導放管を使用することにより赤外線放射を減らし、最良の視感度ではないが従来技術よりは高い視感度を得てもよい。

ここで用いた"視感度"という用語は、光源に よって放射された全波長にわたる全光束(ルーメ 該周極構造は、各導波管キャピティの陰極に対し、別々の金属陽極16を別々の安定抵抗18と直別に設けており、該抵抗18は、例えば、不純物を添加されていない又は少し添加したN型シリコンのような抵抗材料でできている層19から半導体リソグラフィー技術によってつくられている。

各周極構造18は対応する階極構造12に整合させて配置しなければならない。かくして、全ての導放管キャビティ放電が個別に安定し、共通電 遊により同時に作動する。

各キセノン放電源10は、従来の。中空陰極ノーマルグロー。モードで作動するように配置されている。これは、約1torr-cm に等しい圧力時間寸法(。pd。)の値のキセノンで達成される。全長約7000mm、各側面14の寸法350mmの細長い正方形導波管キャピティ12については、約39atmのキセノン圧力を必要とする。希ガス内の最大ノーマルグロー電流は約1マイクロアンペアノcm。(torr 圧力)。である。39atmでは、この値は816アンペアノ

ンで表わしたもの)を、ワットで表わした光源の 全入力で除したものである。

(実施例2-タングステン白熱ランプ)

タングステン形式の白熱ランプについて本発明の原理を用いることにより、放射面がもっと低温で作動して従来技術のタングステン形式の白熱ランプの効率及び作動寿命がともに増加する程度にまで赤外線放射を減少させる白熱ランプを提供する。

タングステン形式の白熱ランプへの本発明の原 理の適用を理解するためには、タングステン放射 体のような白熱体による連続スペクトル放射の発 生に関連する通程を説明するのがよいである う。

主要な放射過程は、タングステン原子の原子核の近くを通る移動電子の偏向である。その偏向は、マックスウェルの法則により放射をもたらす加速度を有している。偏向と運動量の損失は量子化されていないので、フォトンエネルギも量子化されず、連続的な放射スペクトルとなる。しかしながら、他の電子による放射吸収が高く、放射輸

送 (radiation transport) についての吸収係数は大きい。吸収係数は、放射浸透深さの逆数であり、いわゆるスキンデフス (skin depth) は次式により示される。

 $\delta = \sqrt{2/(\omega \sigma \mu)} = \sqrt{\lambda \rho / (\pi c \mu)}$  ここで $\lambda$ は放長、 $\rho$ は金属の抵抗、cは自由空間での光の速度、 $\mu$ は透出率である。例えば、波長を $700 \, \mathrm{nm}$ 、 $2000 \, \mathrm{K}$  でのタングステンの抵抗を $59.1 \, \mu \, \Omega \cdot c$  四にとると、 $\lambda$  キンデフスの値は $187 \, \mathrm{nm}$ となる。

吸収長さが物体寸法よりも十分小さく温度が 均一である体積内では、放射フォトンの内部 常に多くのものが放射され、出ていく何倍もの ものが再吸収される。かくして、放射が効率的 に止められ、出ていく可能性はほとんど無視する ことができ、放射光東密度は内部温度と熱力学取 射エネルギのスペクトルパワー分布は、局所的な 温度での黒体分布になる。しかしながら、表面か らの放射は、金属内の自由電子プラズマと外部の 真空との境界を構成する表面の反射特性によって

される。本発明により、第4A図及び4B図を更に詳細に参照して、タングステン表面24が導放管22により穴をあけられており、該導波管は好ましくは正方形で内面22A乃至Dにより形成され、該内面は幅350nmで懸摩は150nm、深さは約7000nmである。

キャピティ導波管22は700nmのカットオフ波長を有している。それらの壁は更に低いカットオフ波長を有するQの低い導波管となろう。その壁は約1スキンデフスの厚さ(150nm)であるので、それらの壁により、隣接するキャピティ導波管22が相互に連結してより大きな断面及びカットオフ波長となることはない。

表面24に差し向けられた700mmより長い波長の内部発生放射は、キャピティ導被管がその波長よりも大きな放射モードとはならないため、キャピティの底面で反射する。700mm以上の波長のフォトンは、キャピティ導放管の側壁22A乃至Dで放射されたものだけが表面に到達する。しかしながら、側壁内で発生したフォトンのE-フィールドとH-フィールド

変化する。電子密度及び電子衝突頻度から、又は その代わりに導電率からこのような表面の反射率 を計算することができることは当業界で周知である。タングステンに対する値を代入すると、可視 領域では周知の放射率(= 1 - R)である 0.45が得られ、100nm波長では0.1乃 至0.15に減少する。かくして、タングステン 表面からの放射スペクトル分布は、同一温度の無 体よりも比例的に赤外線が少なくなる。

タングステンの放射スペクトルが、タングステン内部の黒体放射スペクトルに表面伝達率(放射率)を乗ずることにより算定することができるけれども、放射される実際のフォトンは、表面のカザンス内からでてくることに留意することは重要なことである。全ての内部フォトとは、表面に到達する前に吸収されて再放射され、表面のカザかなスキンデフス内で放射される連鎖の最後のものだけが表面に到達してそこから出ていく。

1又は2表面スキンデフス内で放射されたこれ らの放射フォトンについて、本発明の原理が適用

は該壁を貫通し、壁が、波長よりもずっと小さいスキンデフスの厚さに匹敵するため、キャピティの導波管表面を横切る連続関係に従わなければならない。このようなフィールドは700 nmより長い波長について導波管に生ずることはないので、金属壁内にも生じない。従って、このような放射についての選移確率はゼロである。

700 nmより長い被長のフォトンは、キャビティ導被管の間の分離体の露出面の1スキンデフス内からのみ、放射されうる。これらは、元の表面積と比較して、第4A図及び4B図に示す寸法の約50%面積が減少する。更に、放射領域が薄くかつ内部から同一波長のフォトンが到達しないため、放射光束密度は熱力学平衡に達せず、無体平衡レベル以下のままである。無体レベルの20%の光束が到達し壁の境部が全部で表面積の半分であると仮定すると、700 nmより長い波長のであると仮定すると、700 nmより長い波接の対1/10にすぎない。導波管のカットオフよりも小さな波長の可視領域フォトンは、導波管

の内部から発生しようとキャピティ導波管の整内 から発生しようと、放射を邪魔されることはな く、それらの光束は風体レベルに違する。

その結果、可視領域放射に対する赤外線放射の 量は大きく減少する。表しは、可視光線放射が無 休レベルに達し赤外線放射がタングステンの放射 の1/10に減少するものとして、ルーメン出力 及び全放射出力を算定したものである。又、表 1 (第8図)には、1万時間あたりの厚さ(ミクロ ン) で蒸発速度が与えられている。2100°K では、この量は、キャピティ導放管寸法の1.4 %である。この表面形状は平面よりももっと大き な表面エネルギを有しているので、蒸発、再凝結 及び表面移動が生じ導波管キャビティを満たして 閉じる。更に高温におけるより大きな蒸発速度で は、1万時間よりも短い時間内にキャビティ形状 に致命的な歪みが生ずることが考えられる。従っ て、1万時間の寿命に対する作動温度の上限は約 2100°Kと考えられる。表1に記載したよう に、この温度でも、1000ルーメンにつき数 cm の表面積を必要とするだけで60万至80 ルーメン/ワットの視感度を達成することができ、従来技術の白熱ランプの視感度を大きく上回って改善されている。

第5図は従来技術によるタングステン放射体からの放射スペクトルパワー分布の略図であり、一方、第6図は本発明によるタングステン放射体のスペクトルパワー分布の略図である。700nmより長い放長の赤外線放射が大きく減少していることが容易にわかる。

#### (実施例3-白熱ガスマントル)

前に説明したように、従来技術では、いわゆるマントルを設けることによってガス火炎灯の視感度を高めることが知られており、該マントルは、火炎に接触して1500° K近くの温度まで加熱される。従来技術で用いるマントルは、数%のセリウム酸化物を加えたトリウム酸化物から成るのが典型的である。ほとんど自由電子をもたないため、又、基本的な赤外線吸収/放射帯が5000nmよりも長い波長にあるため、マントルのセラミック体は比較的赤外線放射の少ない放射体となる。

セリウムの混入により、スペクトルの可視光線 領域での吸収/放射遷移が増加し1500°Kで の可視光線放射が増加する。

その結果いわゆるガスマントルは1500° Kにおいて、約2ルーメン/ワットの視感度を達成し、その値は、同一温度でのタングステン放射体で達成できる0、2ルーメン/ワットよりも高い値となる。ガスマントルは、電気が利用できない用途において、燃料にガスを使う携帯用ランプに広く使用されている。

第7A、B及びC図を参照して、本発明により、パーナ26を備えた白熱ガスマントル装置を示し、該パーナ26は、周囲のセラミックマントル体30を1500°K近くの所定の温度に加熱する火炎28をつくる。セラミック体マントル30は、前述したように、数%のセリウム酸化物を加えたトリウム酸化物で形成されている。しかしながらマントル30は、複数の導放管キャビティ32(第2図及び第4図のキャビティに似たもの)を形成する穴を形成しており、該キャビティは、幅350mmの壁34A乃至Dによって

形成されている正方形横断面を有している。

球波管キャピティは700mmのカットオフ波 長の導波管を形成し、それにより実施例2のタン グステン放射体と同様に長い波長の放射を抑制する。その結果、セラミック体30を1500°K に加熱するためのガス火炎源26からの熱は少な くてすみ、その温度では、可視光線が前述したように放射される。そのため、ルーメン時間あたり の燃料消費(燃料にガスを使う光源についての示 性数であり、電気光源についてのルーメン/ワットに似たもの)が大きく減少する。

本発明を好ましい実施例について説明してきたが、より広い側面を包含する発明の範囲から逸脱することなく変更や修正がなされうることは当業者に明らかであろう。使って、意図するところは、前述の説明に含まれる又は添付図面に示す全ての事項は、例示として解釈すべきであって限定するものではない。

### 4.図面の簡単な説明

第1図は、従来技術の高圧キセノン放電ランプ の放長を関数とした放射スペクトル図である。

## 特開平3-102701(8)

第2A図は、本発明の原理を具現化した高圧やセノン放電ランプの拡大部分断面板略図である。

第2B図は、第2A図のB-B線に沿った拡大 断面図である。

第3回は、第2回の高圧キセノン放電ランプの 放長を関数とした放射スペクトル回である。

第4A図は、導致管キャピティ列の平温路図である。

第4B図は、第4A図のB-B線に沿った断面 図である。

第5図は、 従来技術によるタングステン放射体からの放射スペクトルパワー分布の略図である。

第6図は、本発明によるタングステン放射体からの放射スペクトルパワー分布の略図である。

第7A図は、本発明による白熱ガスマントルの 実施例の略図である。

第7B図は、第7A図のB-B線に沿った拡大 断面図である。

第7C図は、第7B図のC-C線に沿った拡大

断面図である。

第8回は、タンプステンハルーメン出力及び全数的出力を示したものである。

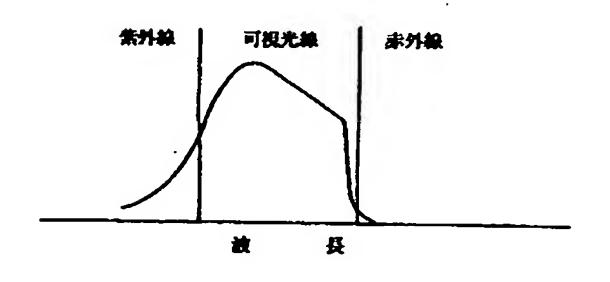
- 10・・・・キセノン放電源、
- 12・・・・導放管キャピティ、
- 16 · · · · 陽極、
- 18 · · · · 抵抗、
- 22・・・・導波管キャピティ、
- 24・・・・タングステン表面、
- 26・・・・パーナ、
- 28 · · · · 火炎、
- 30・・・マントル体、
- 32・・・・導波管キャビティ。

第 国 四 高圧キセノン放電ランプのスペクトル (従来技術) 赤外線

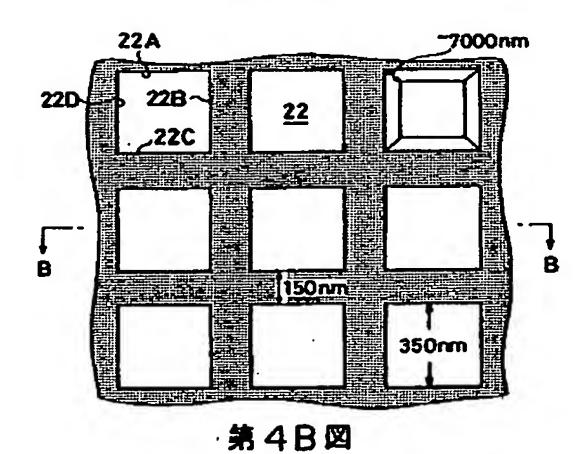
及

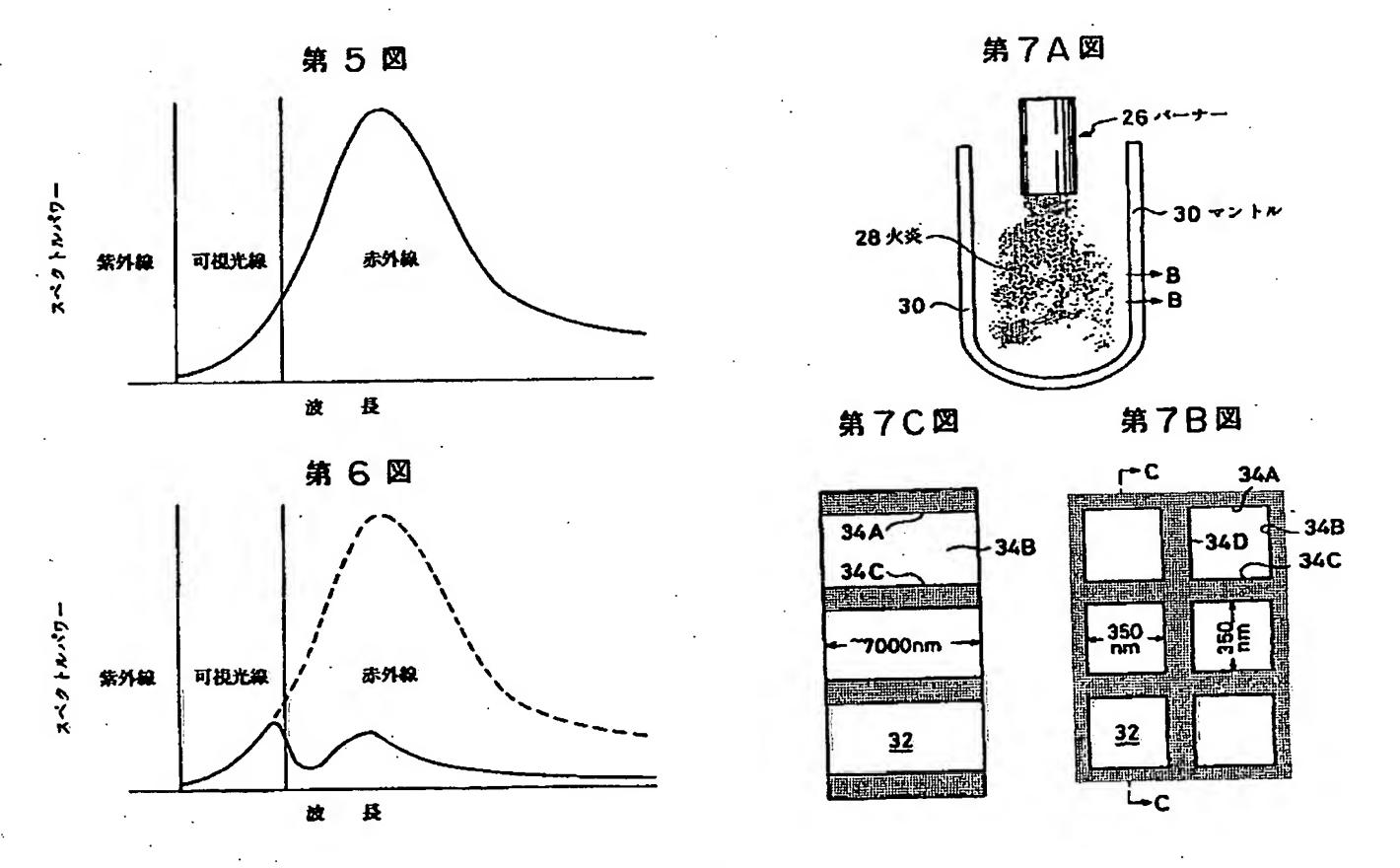
第3図 350nm キャピティ真圧キセノン は電ランプのスペクトル

被



第44図





第8図

(表1)

温度 (*K)	cm²	ワット cm <sup>2</sup> (注1)	~ ノット	深発速度 (1万時間あたりの 厚さ(ミクロン))
1800.	36.7	1.42	25.9	1.11E-6
1900.	75.5	1.86	40.6	2.61E-5
2000.	145.	2.37	61.1	4.29E-4
2100.	262.	2.98	87.9	5.40E-3

注1:赤外線放射をタングステンの赤外線放射の 大0と仮定